# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Requested Patent:

JP10050494A

Title:

AN ELECTROSTATIC DISCHARGE PROTECTION CIRCUIT;

Abstracted Patent:

EP0803955, A3;

Publication Date:

1997-10-29;

Inventor(s):

KNIGHT JONATHAN R (US); DEVORE JOSEPH A (US); TEGGATZ ROSS E (US)

Applicant(s):

TEXAS INSTRUMENTS INC (US);

Application Number:

EP19970302767 19970423;

Priority Number(s):

US19960016185P 19960425;

IPC Classification:

H02H9/04 ;

Equivalents:

#### ABSTRACT:

An ESD protection circuit which includes high voltage and reference voltage terminals, an SCR circuit coupled between the terminals and a breakdown device (22) which becomes electrically conductive commencing at a predetermined voltage thereacross and coupled between the terminals to trigger conduction of the SCR circuit. The protection circuit protects a device to be protected coupled between the terminals, the predetermined voltage being a voltage below any voltage which will damage the device to be protected. The SCR circuit includes a PNP transistor (Q1) having an emitter coupled to the high voltage terminal, a base and a collector, an NPN transistor (Q2) having an emitter coupled to the reference voltage terminal, a base coupled to the collector of the PNP transistor (Q1) and a collector coupled to the base of the PNP transistor (Q1), a resistance (R1) between the high voltage terminal and the base of the PNP transistor (Q1) and a resistance (R2) between the reference voltage terminal and the base of the NPN transistor (Q2). The breakdown device (Z2) is a Zener diode. The Zener diode is coupled between the base of the PNP transistor (Q1) and the reference voltage terminal.

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平10-50494

(43)公開日 平成10年(1998) 2月20日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H05F 3/02

H05F 3/02

L

#### 審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平9-109549

(22)出願日

(32)優先日

平成9年(1997)4月25日

(31) 優先権主張番号 016185

1996年4月25日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 590000879

テキサス インスツルメンツ インコーポ

レイテツド

アメリカ合衆国テキサス州ダラス、ノース

セントラルエクスプレスウエイ 13500

(72)発明者 ロス イー. テッガツ

アメリカ合衆国テキサス州マッキニー、ス

トーンポイント 2908

(72)発明者 ジョセフ エイ. ドゥポア

アメリカ合衆国テキサス州ダラス、エコー

パレイ ドライブ 8832

(74)代理人 弁理士 浅村 皓 (外3名)

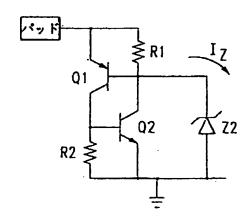
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 高電圧静電気放電保護回路

#### (57)【要約】

【課題】 小さなチップ面積のESD保護構造を提供す ること。

【解決手段】 ESD保護回路であって、高電圧端子及 び基準電圧端子と、端子間に結合されるSCR回路と、 そこを通る所定の電圧で電気的に導電を開始する、SC R回路の導電をトリガするために端子間に結合される降 伏デバイス (22) とを有する。SCR回路は、高電圧 端子に結合されたエミッタ、ベースおよびコレクタを有 するPNPトランジスタ(Q1)と、基準電圧端子に結 合されたエミッタ、PNPトランジスタ(Q1)のコレ クタに結合されたベース、及びPNPトランジスタ(Q 1)のベースに結合されたコレクタとを有するNPNト ランジスタ (Q2) と、高電圧端子とPNPトランジス タ(Q1)のベースとの間の抵抗(R1)と、基準電圧 端子とNPNトランジスタ(Q2)のベースとの間の抵 抗(R2)とを有する。降伏デバイス(22)はPNP トランジスタ(Q1)のベースと基準電圧端子との間に 結合される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ESD保護回路であって、

高電圧端子及び基準電圧端子と前記端子間に結合される SCR回路と、

そこを通る所定の電圧で電気的に導電を開始する、前記 SCR回路の導電をトリガするために前記端子間に結合 される降伏デバイスとを含むESD保護回路。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高電圧半導体構成 部品ピンと共に用いる高電圧静電気放電(ESD)保護 回路に関連する。

#### [0002]

【従来の技術】アナログ設計において、集積回路のピン の幾つかがその通常の動作中比較的高い電圧で操作しな ければならない場合が頻繁にある。そのような半導体デ バイスの静電気放電の問題及びそのような放電によって 生じる問題はよく知られており、それによって生じる問 題を最小にするため過去に非常に多くの努力がなされて きている。従来技術の高電圧トランジスタ(即ち、ピン 上に約50ボルトから100ボルトの電圧が流れることが可 能)におけるESDの問題に対する一つの解決策は、ビ ンと基準電源との間にツェナー・ダイオードを配置する ことであった。これは例えば、高電圧ピンに接続される トランジスタ・ソース又はトランジスタ・ドレインとト ランジスタ・ゲートとの間のツェナー・ダイオード、及 びトランジスタ・ゲートからトランジスタ・ソースとト ランジスタ・ドレインの他方へのレジスタなどの形をと り得る。ツェナー・ダイオードは、保護されるトランジ スタの降伏電圧より小さい降伏電圧を有するように設計 される。従って、トランジスタを通る電圧がツェナー降 伏電圧を越えるとき、ツェナー・ダイオードは降伏して トランジスタを導電させ、それによってトランジスタを 通る過度に大きな電圧が存在しないようにしている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ESDの問題に対する上述の解決策及び一般のESD保護回路に伴う問題は、例えば前述のツェナー・ダイオードのようなトランジスタ構造が、ESDストレスに耐えることができる構造をつくるための非常に大量のチップ表面と、消散(dissipate)されなければならない非常に大量の電力を使用することであった。実際の回路において、そのようなESD構造は例えば約3000マイクロメータの幅を必要とする。半導体構成部品の微小化が続くのに伴い、所定のパラメータ群を提供する半導体デバイスに必要とされる領域のいかなる最小化も不可欠であることは明らかである。

【0004】SCRデバイスもESD保護のために従来 技術で用いられてきている。このようなデバイスは、よ り高い電圧レベルで(即ち、約60ボルトレベルで)その ファイヤリング(firing)電圧を正確に制御することが できないため、従来技術ではうまく用いられなかった。 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明に従って、上述の 目的を達成し従来技術の構造と比べ約10分の1又はそれ以下のチップ面積を必要とする高電圧半導体デバイス のためのESD構造が提供される。

【0006】簡単に言えば、ツェナー・ダイオード降伏メカニズムは、従来技術より集積回路で消散されるために必要とするエネルギーがより小さくてすむと共に、電流を扱う効率がより高いSCRをトリガするために用いられる。従来技術の解決策は、ESDストライクを消散するために降伏メカニズムのみを用いる。本発明のESD保護回路は、通常の高電圧動作中オフのままであるが、そこへ結合するピン及びデバイスをESDストライクから保護する。

【0007】本発明に従ったESD構造(configuration)は、SCRデバイスをトリガするために降伏メカニズムを用い、これによりSCRデバイスを通る電圧降下が最小化される。電圧降下が最小化されるため、全体の瞬間電力消散は従来技術の構造で必要とされるよりずっと小さい。従って、ESD保護回路のために必要とされるシリコン領域がより小さい。更にSCR回路は、接合降伏メカニズムより装置面積当りより多くの電流を流すことができ、さらにこの特性は減少された面積をESD構造が有することを促進する。

#### [0008]

【発明の実施の形態】本発明の一実施例を図面を参照し て説明する。 まず図1では、パッド又はピン11と基準 電源との間に接続されるソース3、ドレイン5、及びゲ ート7を有するDMOSトランジスタ1を含む典型的な 従来技術の高電圧ESD保護回路が示されている。ツェ ナー・ダイオード9がゲート7とドレイン5との間に結 合され、ドレインはVロロ又は高電圧を供給することので きる他のソースに結合されるパッド11に結合されてい る。ゲート7と、基準電圧に結合されているソース3と の間にレジスタ13が結合される。ダイオード15は、 DMOSトランジスタ1の形成の結果として半導体構造 体 (bulk) 内につくられるダイオードである。 用いられ るESD保護メカニズムは、ツェナー・ダイオード9及 びレジスタ13の形をとるESDデバイスの降伏であ る。ESDストレスが、ダイオード9とレジスタ13と を含む、例えば60ボルトの降伏電圧を有するESD保 護回路を通して供給される。ESDストレス電流が高い ため (例えば、1500 ohmの人体モデル・テスト で2kVに対し1.3アンペアが典型的である)、ES D保護回路を通る瞬間電力消散は非常に高い(提供され ている従来技術の例において約60ボルト×1.3アン ペア=78ワット)。ESD保護回路をESDストレス に持ちこたえさせるため、その構造はESDストライク

による瞬間電力消散に耐えることができるように十分に 大きく作られなければならない。

【0009】次に図2及び図3では、前述の従来技術の保護回路より小さなシリコン領域を提供する本発明に従ったESD保護回路が示されている。図2に示す回路は、パッド又はピンを介して高電圧のソースに結合されるエミッタ、及びNPNトランジスタQ2のベースに結合されるコレクタとを有するPNPトランジスタQ1から成るSCRを有する。トランジスタQ1のベースは、例えば接地などの基準電源に結合されるエミッタを有するトランジスタQ2のコレクタに結合される。レジスタR1はトランジスタQ1のエミッタとベースとの間に結合され、レジスタR2はトランジスタQ2のベースとエミッタとの間に結合される。ツェナー・ダイオードZ2はトランジスタQ1のベースと基準電圧のソースとの間に結合される。

【0010】図2の回路は図3では、P型エピタキシャ ル層21がトランジスタQ1のコレクタとトランジスタ Q2のベースの両方を有する集積回路の実施例において 示されている。トランジスタQ1のベース及びトランジ スタQ2のコレクタである高電圧N型ウェル23は、層 21内に配置される。ウェル23内のP+型領域25 は、レジスタR1を提供するウェル23内のN+型領域 29と共にパッド又はピン27に結合されるトランジス タQ1のエミッタを形成する。層21内のN+型領域3 1は、N+型領域31から離れて配置されるP+領域3 3、及びN+型領域31の下に拡散されるN-型領域3 5によって提供されるレジスタR2と共にトランジスタ Q2のエミッタを形成する。ツェナー・ダイオード22 は、層21との接合を更に形成する高電圧N型ウェル2 3内に低電圧N型タンク37を加えることによって提供 される。P+型領域33及びN+型領域31は、パッド 27が高電圧生成ソースに接合される基準電圧のソース に結合される。

【0011】図2に関し、動作において、ピン又はパッドと基準電圧との間の電圧が増加するにつれて、トランジスタQ1のエミッタはレジスタR1を介してそのベースに関して順方向にバイアスされ、トランジスタQ1のベースで電位は上昇しはじめる。しかし、ツェナー・ダイオード22の降伏電圧に達するまで電流が流れる場所がないため、この降伏電圧に達するまで電流が流れる場所がないため、この降伏電圧点で、電流フローがレジスタR1を介して開始し、トランジスタQ1をオンにし、トランジスタQ2へ及びレジスタR2を介してベース電流を提供する。これによりトランジスタQ2がオンになり、トランジスタQ1から引き出されるよりずっと大きなベース電流を生じさせ、迅速にピン又はパッド上の静電気放電から守る。

【0012】トランジスタQ1及びQ2は共にSCR構造を形成する。この構造はツェナー・ダイオード22と

共に、図1のツェナー・ダイオード21に代わり、従来 技術のツェナー・ダイオード21によって必要とされる 半導体領域より、一般的に10%以下であるが、実質的 に小さい領域を必要とする。

【0013】更にツェナー・ダイオード22は、図4 (a) に示されるように接地に短絡 (short circuited )されるゲート及びソースを有するNMOSデバイス 41、又は他の全ての構成要素が図2を参照して上記で 説明したものと同じである図4(b)に示されるように レジスタR1を介してパッドに結合されるゲート及びソ ースを有するPMOSデバイス43によって置き換える ことができる。更なる代替例として、図2のツェナー・ ダイオード22は、トランジスタQ2に並列なソース・ ドレイン・パスを有し、図5に示されるようなMOSデ バイス51のゲートと接地との間に結合されるレジスタ R3を有するツェナー・スタック53などのような他の トリガ・メカニズムを用いるMOSデバイス51で置き 換えることができるか、或いはトリガ・メカニズムは図 6に示されるような厚いフィールドを有するMOSデバ イス6 1のVtであってもよい。 図7に示されるように 接地に結合されるエミッタを有するNPNバイポーラ・ デバイス71、又は図8に示されるように接地に結合さ れるゲート及びエミッタを有するNPNバイポーラ・デ バイス81も又、ツェナー・ダイオード22に置き換え られてもよい。ツェナー・ダイオード22は更に、ES D構造のものとは全く異なって配置される接合ダイオー ドによっても置き換えられ得る。

【0014】本発明は特定の好ましい実施例を参照して 説明されたが、種々の変形及び変更はこの技術の分野の 習熱者にとって明白であろう。したがって、添付の特許 請求の範囲は、従来技術の視点から可能な限り、あらゆ るこれらの変形及び変更を包含することを意図する。 【0015】以上の説明に関して更に次の項を開示す

【0015】以上の説明に関して更に次の項を開示する。

- (1) ESD保護回路であって、高電圧端子及び基準 電圧端子と前記端子間に結合されるSCR回路と、そこ を通る所定の電圧で電気的に導電を開始する、前記SC R回路の導電をトリガするために前記端子間に結合され る降伏デバイスとを含むESD保護回路。
- (2) 第1項に記載の回路であって、前記端子間に結合され保護されるデバイスをさらに有し、前記所定の電圧は保護される前記デバイスが損傷を受ける任意の電圧より小さい電圧である回路。
- (3) 第1項に記載の回路であって、前記降伏デバイスはツェナー・ダイオードである回路。
- (4) 第2項に記載の回路であって、前記降伏電圧は ツェナー・ダイオードである回路。
- (5) 第2項に記載の回路であって、前記降伏デバイスはMOSデバイスである回路。

【0016】(6) 第2項に記載の回路であって、前

記降伏デバイスはNPNトランジスタである回路。

- (7) 第1項に記載の回路であって、前記SCR回路は、前記高電圧端子、ベース、及びコレクタに結合されるエミッタを有するPNPトランジスタと、前記基準電圧端子に結合されるエミッタ、前記PNPトランジスタのコレクタに結合されるベース、及び前記PNPトランジスタのベースに結合されるコレクタとを有するNPNトランジスタと、前記高電圧端子と前記PNPトランジスタの前記ベースとの間の抵抗と、前記基準電圧端子と前記NPNトランジスタの前記ベースとの間の抵抗とを有する回路。
- (8) 第2項に記載の回路であって、前記SCR回路は、前記高電圧端子、ベース、及びコレクタに結合されるエミッタを有するPNPトランジスタと、前記基準電圧端子に結合されるエミッタ、前記PNPトランジスタのコレクタに結合されるベース、及び前記PNPトランジスタのベースに結合されるコレクタとを有するNPNトランジスタと、前記高電圧端子と前記PNPトランジスタの前記ベースとの間の抵抗と、前記基準電圧端子と前記NPNトランジスタの前記ベースとの間の抵抗とを有する回路。
- (9) 第3項に記載の回路であって、前記SCR回路は、前記高電圧端子、ベース、及びコレクタに結合されるエミッタを有するPNPトランジスタと、前記基準電圧端子に結合されるエミッタ、前記PNPトランジスタのコレクタに結合されるベース、及び前記PNPトランジスタのベースに結合されるコレクタとを有するNPNトランジスタと、前記高電圧端子と前記PNPトランジスタの前記ベースとの間の抵抗と、前記基準電圧端子と前記NPNトランジスタの前記ベースとの間の抵抗とを有する回路。
- (10) 第4項に記載の回路であって、前記SCR回路は、前記高電圧端子、ベース、及びコレクタに結合されるエミッタを有するPNPトランジスタと、前記基準電圧端子に結合されるエミッタ、前記PNPトランジスタのコレクタに結合されるベース、及び前記PNPトランジスタのベースに結合されるコレクタとを有するNPNトランジスタと、前記高電圧端子と前記PNPトランジスタの前記ベースとの間の抵抗と、前記基準電圧端子と前記NPNトランジスタの前記ベースとの間の抵抗とを有する回路。
- 【0017】(11) 第3項に記載の回路であって、前記ツェナー・ダイオードは前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される回路。
- (12) 第4項に記載の回路であって、前記ツェナー・ダイオードは前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される回路。
- (13) 第9項に記載の回路であって、前記ツェナー・ダイオードは前記PNPトランジスタの前記ベースと

前記基準電圧端子との間に結合される回路。

- (14) 第10項に記載の回路であって、前記ツェナー・ダイオードは前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される回路。
- (15) 第2項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは前記基準電圧端子に結合されるゲート及びソースを有するNMOSデバイスであって、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスを有する回路。
- 【0018】(16) 第6項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは前記基準電圧端子に結合されるゲート及びソースを有するNMOSデバイスであって、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスを有する回路。
- (17) 第2項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは前記PNPトランジスタの前記ゲートに結合されるゲート及びソースを有するPMOSデバイスであって、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスを有する回路。
- (18) 第6項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは前記PNPトランジスタの前記ゲートに結合されるゲート及びソースを有するPMOSデバイスであって、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスを有する回路。
- (19) 第2項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスと、前記高電圧端子と前記基準電圧端子との間に結合され直列に接続されるダイオード及びレジスタとを有するNMOSデバイスであって、前記NMOSデバイスのゲートは前記ダイオードとレジスタとの接合に結合される回路。
- (20) 第6項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスと、前記高電圧端子と前記基準電圧端子との間に結合され直列に接続されるダイオード及びレジスタとを有するNMOSデバイスであって、前記NMOSデバイスのゲートは前記ダイオードとレジスタとの接合に結合される回路。
- 【0019】(21) 第2項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスを有するNPNトランジスタである回路。
- (22) 第6項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスを有するNPNトランジスタである回路。
- (23) 第2項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスと、前記基準電圧端子に結合されるゲートとを有するNPNトランジス

夕である回路。

(24) 第6項に記載の回路であって、前記降伏デバイスは、前記PNPトランジスタの前記ベースと前記基準電圧端子との間に結合される電流パスと、前記基準電圧端子に結合されるゲートとを有するNPNトランジスタである回路。

【0020】(25) ESD保護回路であって、高電 圧端子及び基準電圧端子と、端子間に結合されるSCR 回路と、そこを通る所定の電圧で電気的に導電を開始す る、SCR回路の導電をトリガするために端子間に結合 される降伏デバイス (Z2)とを有する。保護回路は端 子間に結合される保護されるべきデバイスを保護し、所 定の電圧は保護される回路が損傷を受ける任意の電圧よ り小さい。SCR回路は、高電圧端子、ベース、及びコ レクタに結合されるエミッタを有するPNPトランジス タ(Q1)と、基準電圧端子に結合されるエミッタ、P NPトランジスタ(Q1)のコレクタに結合されるベー ス、及びPNPトランジスタ(Q1)のベースに結合さ れるコレクタとを有するNPNトランジスタ(Q2) と、高電圧端子と PNPトランジスタ (Q1)のベース との間の抵抗(R1)と、基準電圧端子とNPNトラン ジスタ (Q2) のベースとの間の抵抗 (R2) とを有す る。降伏デバイス(22)はツェナー・ダイオードであ る。ツェナー・ダイオードはPNPトランジスタ (Q1)のベースと基準電圧端子との間に結合される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術に従った典型的な高電圧ESD保護回路の回路図。

【図2】本発明に従った高電圧ESD保護回路の回路図。

【図3】図2の回路の集積回路の実施例の断面図。

【図4】本発明の他の実施例に従った高電圧ESD保護 回路の回路図。

【図5】本発明の他の実施例に従った高電圧ESD保護 回路の回路図。

【図6】本発明の他の実施例に従った高電圧ESD保護 回路の回路図。

【図7】本発明の他の実施例に従った高電圧ESD保護 回路の回路図。

【図8】本発明の他の実施例に従った高電圧ESD保護回路の回路図。

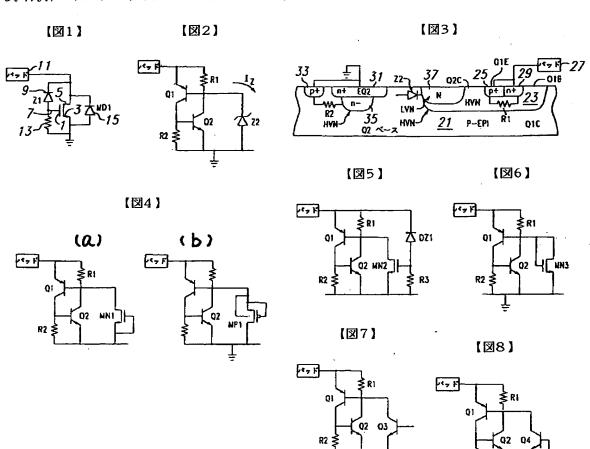
【符号の説明】

Ζ2 降伏デバイス

Q1 PNPトランジスタ

Q2 NPNトランジスタ

R2 抵抗



フロントページの続き

(72)発明者 ジョナサン アール.ナイト アメリカ合衆国テキサス州ダラス、ビッカ リー ブールバード 6315